

課題番号 : F-16-WS-0026
利用形態 : 技術相談
利用課題名(日本語) : ガラス基板への表面処理に関する相談
Program Title(English) : Consultation on surface processing of glass substrate
利用者名(日本語) : 大貫隆司¹⁾
Username(English) : R. Onuki¹⁾
所属名(日本語) : 1) 東洋製罐グループホールディングス株式会社
Affiliation(English) : 1) Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

1. 概要(Summary)

ガラス基板に、所望の微細構造を付設する表面処理方法について、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の設備で可能か相談した。その結果、Deep-RIE を特定のガス雰囲気下で行う方法について、ご提案いただいた。

2. 実験(Experimental)

・なし

【実験方法】

・なし

3. 結果と考察(Results and Discussion)

・なし

4. その他・特記事項(Others)

・なし

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

・なし

6. 関連特許(Patent)

・なし